

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 19 年 12 月 6 日 (2007.12.6)

【公表番号】特表 2003-514056 (P2003-514056A)
 【公表日】平成 15 年 4 月 15 日 (2003.4.15)
 【出願番号】特願 2001-535466 (P2001-535466)
 【国際特許分類】

C 0 8 G 64/00 (2006.01)

C 0 8 J 5/00 (2006.01)

C 0 8 J 5/18 (2006.01)

C 0 8 L 69/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 64/00

C 0 8 J 5/00 C F D

C 0 8 J 5/18

C 0 8 L 69:00

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 10 月 19 日 (2007.10.19)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 200 μ m 押出成形フィルムで測定される欠陥濃度が 1 m² 当たり 250 個以下であるポリカーボネート基体。

【請求項 2】 請求項 1 記載のポリカーボネート基体を出発基体として用いる、欠陥の数が少ないポリカーボネート成形部材の製造方法。

【請求項 3】 200 μ m 押出成形フィルムで測定される欠陥の数が 1 m² 当たり 250 個以下である、ポリカーボネートから製造される成形部材。

【請求項 4】 200 μ m 押出成形フィルムで測定される欠陥の数が 1 m² 当たり 250 個以下および曇り値が 0.5 % 以下であるポリカーボネートを用いて製造されるディスク。

【請求項 5】 200 μ m 押出成形フィルムで測定される欠陥の数が 1 m² 当たり 250 個以下および曇り値が 0.5 % 以下であるポリカーボネートを用いて製造されるシート。